

奖励信息

奖励名称	钝化膜应力导致应力腐蚀的机理
完成人	高克玮,褚武扬,宿彦京,乔利杰,李金许,何健英,钱才富,张跃,李启楷
完成单位	
推荐单位	
授奖机构	教育部
授奖日期	2003年 月 日
奖励种类	科技进步奖
奖励等级	二等奖
奖励编号	
相关项目	Ca系α-Sialon陶瓷纳米力学特性及磨损微观机理